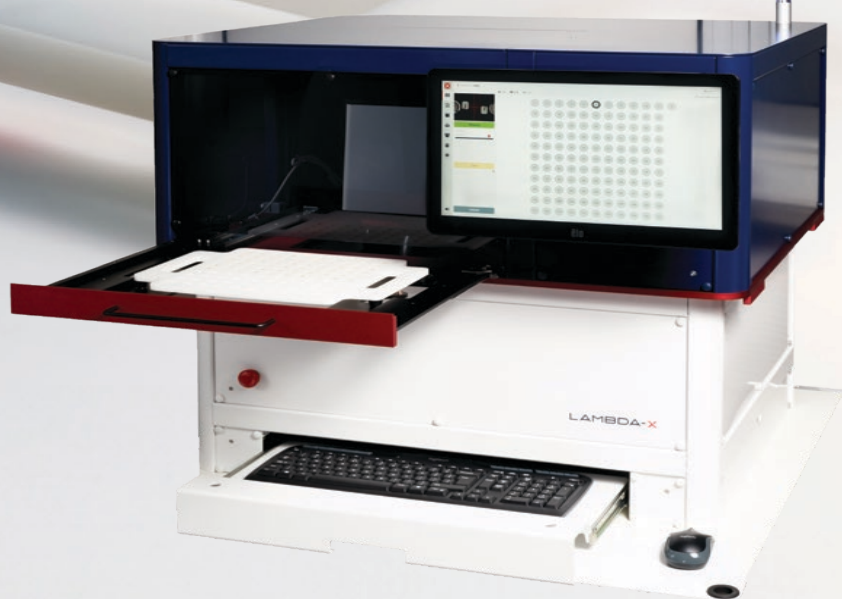


 **NIMO**
MATRIX



300片
每小时

NIMO MATRIX
人工晶体批量光学检测仪
(四合一检测)

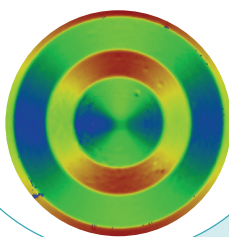
LAMBDA-X
OPHTHALMICS

生产全自动解决方案

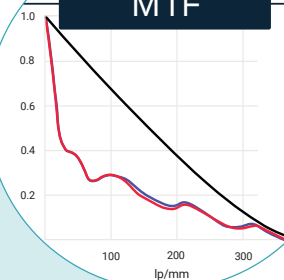
四合一人工晶体检测

300片
每小时

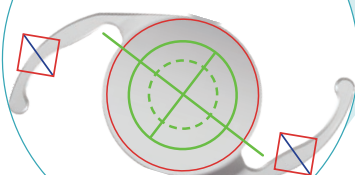
屈光度



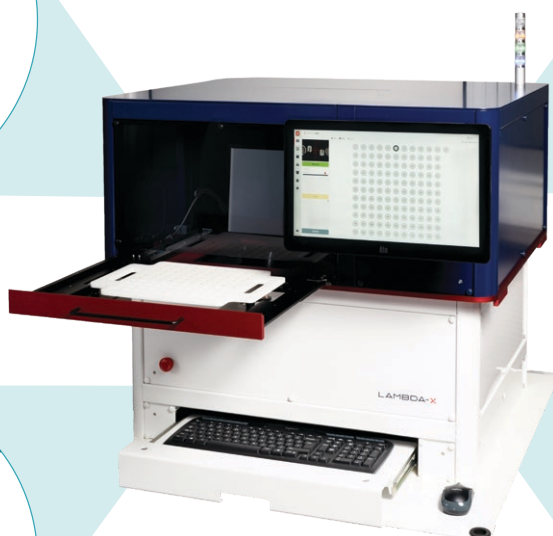
MTF



尺寸



厚度



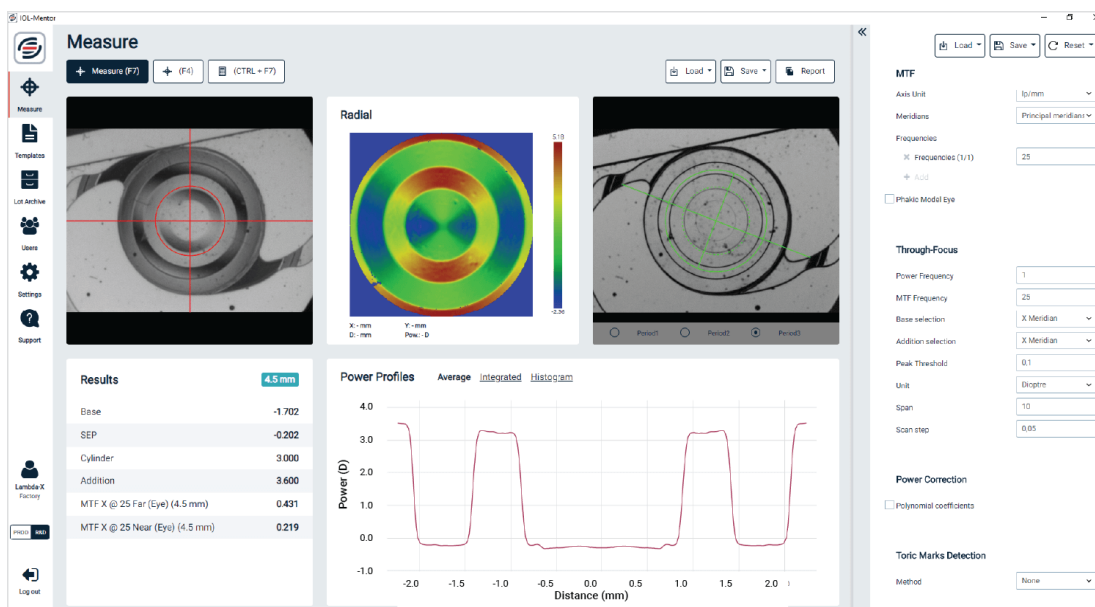
 **NIMO**
MATRIX



屈光度

精确屈光度检测

NIMO MATRIX精确检测人工晶体的光学性能，它提供高分辨率波前地形图和屈光度分布图，检测球镜度、柱镜度、轴位等光学参数，确保生产的晶体高质量。



高精度

通过高清波前地形图和屈光度分布图了解晶体的光学特征

全面分析

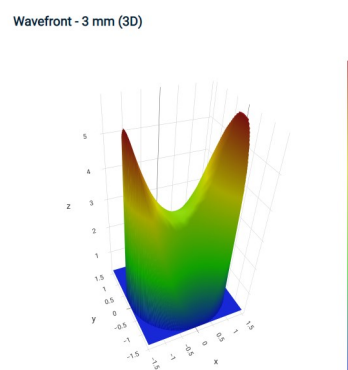
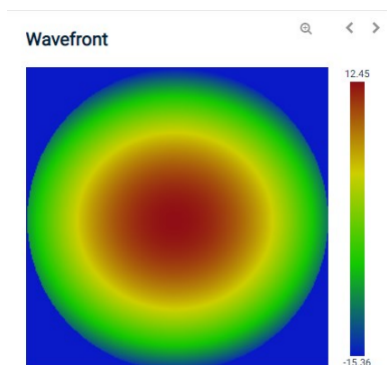
通过测量球镜度、柱镜度和离焦量以此了解晶体的光学品质

晶体检测多样性

支持各种折射型人工晶体检测包括散光晶体、多焦点、EDOF晶体，满足生产需求的多样性

操作方便

简化测量流程，减少操作员依赖性



MTF (调制传递函数)

高分辨率检测

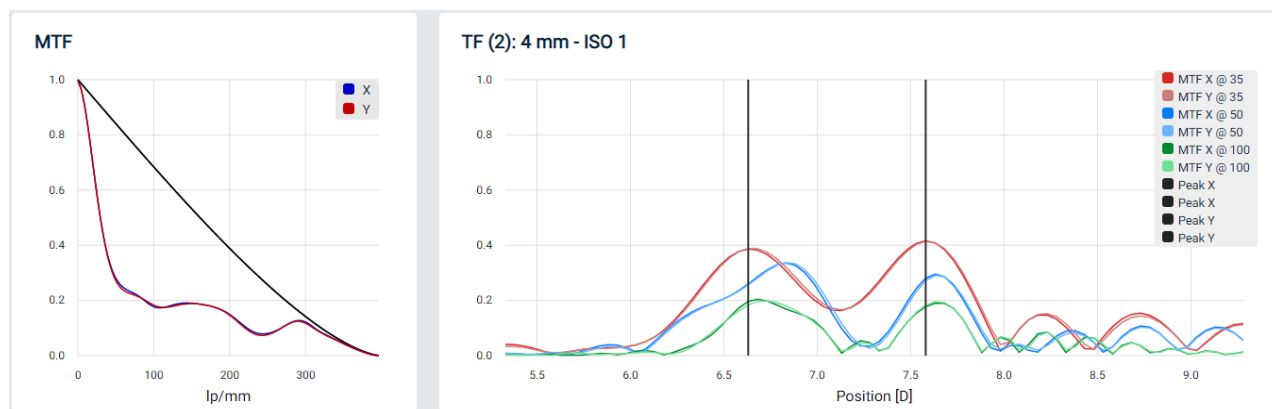
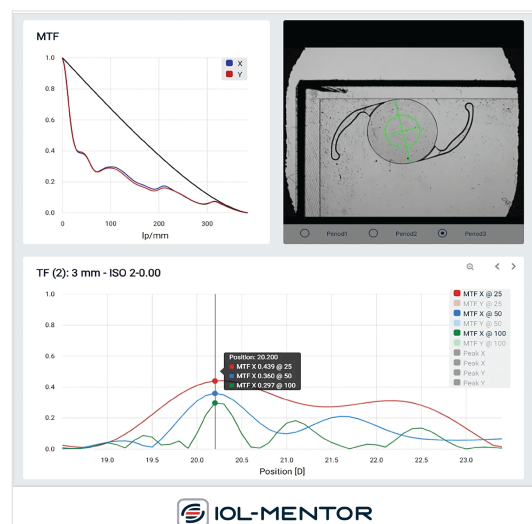
NIMO MATRIX提供了详细的调制传递函数 (MTF) 计算功能，对人工晶体的成像质量进行全面评估。这包括通焦和通频的MTF曲线，为人工晶体厂家提供全面的数据分析。

详细的MTF分析

通焦和通频的MTF曲线了解晶体成像质量

多孔径测量

同时计算3个不同测量孔径下、不同线对下的MTF数据，充分掌握晶体性能



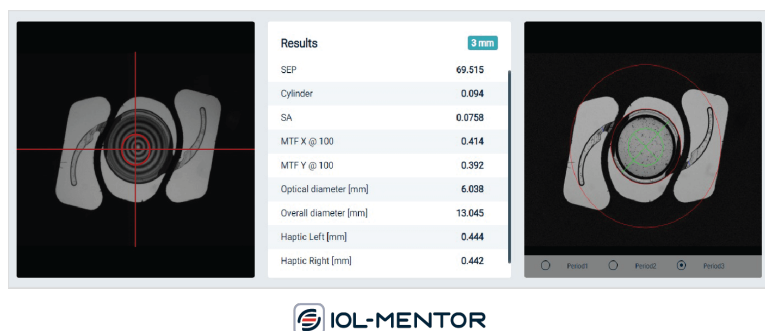
尺寸

精准尺寸检测

NIMO MATRIX可以对人工晶体进行精确尺寸分析，系统能自动识别尺寸，并可根据客户要求，提供定制的检测点。确保在人工晶体生产中进行全面的尺寸分析。

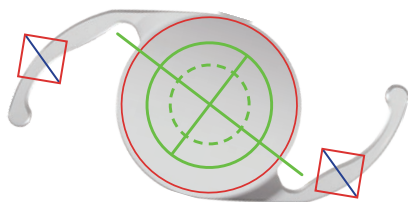
定制测量

根据客户的要求，提供测量点定制，为品控检测带来很大的灵活性



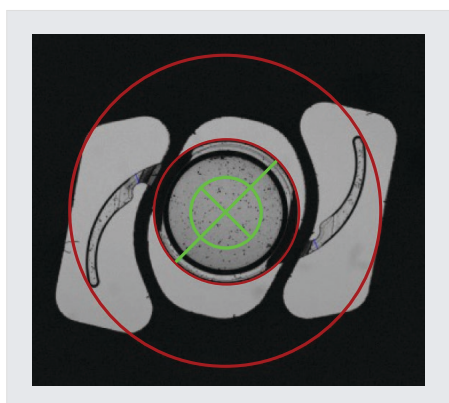
检测范围扩大

可检测晶体的总直径、光学区直径、晶体攀的宽度



检测能力多样

可检测晶体的几何中心和光学中心，进行全面尺寸分析



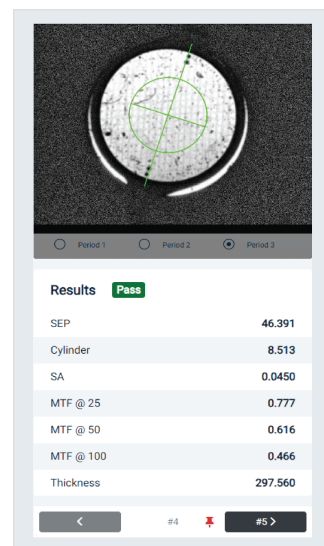
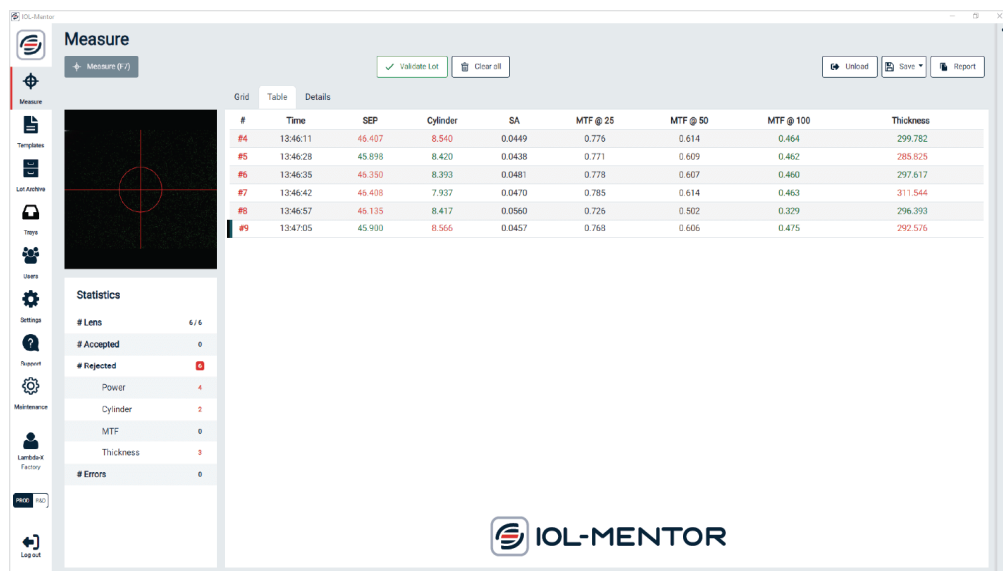
自动识别检测直径

自动检测晶体的直径和光学中心

厚度

精确的厚度检测

NIMO MATRIX具有检测晶体厚度的能力，创新的技术可对晶体多点检测，为生产品控提供全面、可靠的厚度轮廓分析。



多点检测

多点厚度检测，范围包括光学中心、边缘及攀



客户自定义厚度

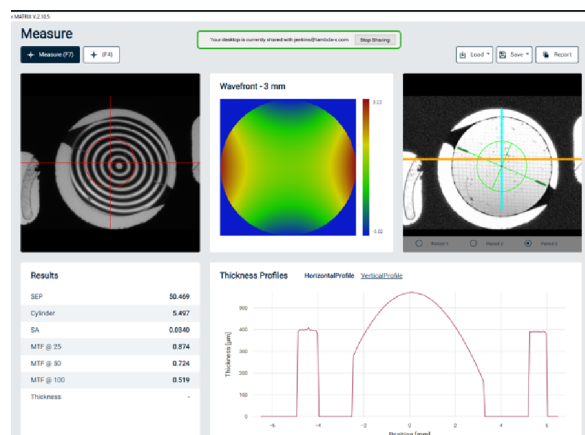
允许客户自定义厚度检测位置

高精度性

确保精确的厚度测量，提供产品品质的稳定性

先进的技术

通过采用共焦感应器进行先进计算，确保高重复性及再现性



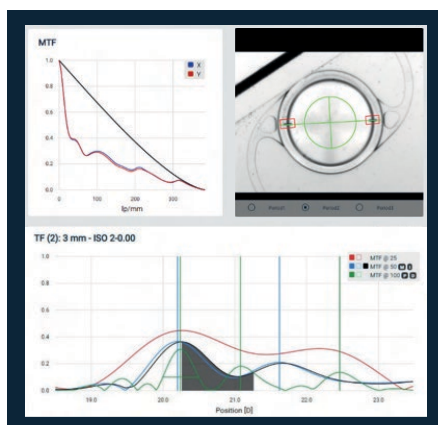
软件插件

额外的检测分析功能

IOL-MENTOR软件设计的非常灵活，提供各种不同功能的插件以满足特定客户的需求。

自动散光标记点识别

自动识别散光标记，减少人为失误及识别散光轴位误差的检测时间



多焦点

在基础软件上，只能检测一个焦点，只有当多焦点插件激活时，能多检测二个焦点（最多3个焦点晶体）。



想了解更多目前已开发的插件，欢迎联系我们！

EDOF晶体

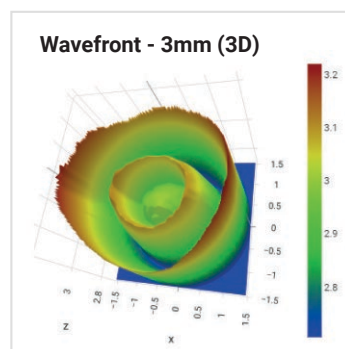
延长景深晶体（EDOF）插件能从通焦的MTF曲线上测量人工晶体焦点延长的深度。在离焦TF曲线中MTF值高于设定阈值（Dof MTF Level）的焦点范围被定义为焦深。此外，还能计算出指定加光部分对应的MTF值。

ISO2模拟眼

作为可选配的插件，ISO2模型眼在近轴中提供5种不同的球差选择(分别是 $0.00\text{ }\mu\text{m}$ 、 $0.10\text{ }\mu\text{m}$ 、 $0.16\text{ }\mu\text{m}$ 、 $0.20\text{ }\mu\text{m}$ 、 $0.28\text{ }\mu\text{m}$)，在非近轴运行中，ISO2模型眼能在 $0.00\sim 0.45\text{ }\mu\text{m}$ 范围内自由选择球差。

公共API

该选项允许开发本地应用程序，也可以远程控制仪器，在自动化环境中整合仪器，并将IOL-MENTOR数据库链接到客户自己的中央数据库。



技术参数

主要指标及功能



适用于检测折射型人工晶体包括单焦、散光、多焦、EDOF晶体

屈光度 | MTF | 直径* | 厚度*

测量原理	纹影相移法
检测速度	每小时可达300片
测量方法	干测
光源波长	546 nm
检测区域	13.5 x 18mm ²
测量孔径	可达 8mm
5毫米孔径下光焦度检测范围	± 100D
8毫米孔径下光焦度检测范围	± 70D
精度(光焦度)	达到 0.7% (or 0.02D)
重复性(光焦度)	0.01 D (ISO 5725)
重复性(厚度)*	<1μm
重复性(尺寸)*	<10μm
输入电压	115-230 V, 50-60 Hz
尺寸 (H x W x D)	860mm x 750mm x 750mm
重量	47kg

* 可选配测量功能

NIMO MATRIX搭载全新的IOL-MENTOR软件、必要的插件及证书



邮箱: info@leadingoptical.com
地址: 上海市嘉定区塔里木路88弄1号201室
网址: www.l-optical.com